応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

第１２回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会のご案内

主催：　応用物理学会・薄膜表面物理分科会
共催：　東京大学　生産技術研究所（予定）
協賛：　日本物理学会（予定）、日本表面科学会（予定）、
日本真空協会（予定）

標記の研究会を下記の通り開催致しますので, 多数の方々のご発表とご参加をお願いしたく, ご案内申し上げます.

記

日時：　平成２３年１２月　９日（金）午後－１０日（土）午前

場所：　東京大学　生産技術研究所
〒153-8505 東京都目黒区駒場４－６－１
TEL: 03-5452-6132
http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html

内容：　低・中・高エネルギーイオン散乱による固体表面・界面の分析，およびイオンビームと固体表面との相互作用.　招待講演：数件，一般講演：１０数件程度.
詳細はhttp://annex.jsap.or.jp/tfspd/activity/conf/index.html　を参照してください.
プログラムなどは，決定次第掲載の予定です.

懇親会：１２月９日（金）夕方

定員：　１００名（研究会と懇親会に参加される場合は，１２月２日（金）までにお申し込み下さい.）

参加費：応用物理学会 薄膜・表面物理分科会会員　１０００円
一般　２０００円，　学生　無料

講演申込み締め切り：１１月１１日（金）
一般講演を申し込まれる場合は，A4 で１頁のアブストラクトと講演者氏名，連絡先：（メールアドレス，電話，ファックス，住所）を下記まで電子メールでお送り下さい.

世話人：福谷克之（東京大学生産技術研究所）、Markus Wilde（東京大学生産技術研究所）

申込・連絡先：　〒153-8505 東京都目黒区駒場 4－6－1
東京大学 生産技術研究所 Markus Wilde （wilde@iis.u-tokyo.ac.jp）
TEL: 03－5452－6148　FAX: 03-5452-6159

以上